

- [6] Коломицт В.Т., Аверьянов В.Л.,
Любин В.М., Приходко О.Ю. //
Solar Energy Mater. 1982. V. 8. N 1. P. 1-8.
[7] Калмыкова Н.П., Мазец Т.Ф., Смогорон-
ская Э.А., Цэндин К.Д. // ФТП. 1988. Т. 23. № 2.
С. 141-146.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
18 мая 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 13

12 июля 1989 г.

05.4; 09

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК ШИРОКИХ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
МОСТИКОВ $YBa_2Cu_3O_{7-x}$

С.Н. Ермолов, Н.А. Кислов,
В.А. Кулаков, В.А. Марченко,
Л.В. Матвеев, А.В. Никулов,
В.Ж. Розенфланц, А.Ю. Серебряков,
А.В. Черных

Поликристаллические образцы $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, представляющие собой систему слабосвязанных сверхпроводниковых гранул, могут быть использованы в качестве чувствительных элементов приемников СВЧ-излучения. В [1] исследовались характеристики таких детекторов на основе точечных контактов из $YBa_2Cu_3O_{7-x}$. Однако более перспективным является использование пленочных структур, обладающих стабильностью характеристик [2].

В настоящей работе приведены результаты исследования отклика широких пленочных мостиков из высокотемпературной керамики $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ на СВЧ-излучение с частотой $f = 39$ ГГц при различных температурах $4.2 < T < T_c$.

ВАХ таких образцов имеют вид, характерный для высокотемпературной керамики, т.е. $d^2V/dI^2 > 0$ при $V > 0$. ВАХ измерялись при различных уровнях СВЧ-мощности, при этом, как и в [2], ступеньки тока не наблюдались. Для больших уровней мощности критический ток подавлялся и ВАХ приближалась к прямой линии (рис. 1). Вид ВАХ позволяет сделать вывод, что межгранулярная связь с исследуемых мостиках осуществлялась на основе эффекта близости [3].

Измерение отклика производилось в макете 8 мм приемника [4]. Подложка с напыленной структурой вставлялась в прорезь шириной 0.5 мм в середине широкой стенки волновода основного сечения с

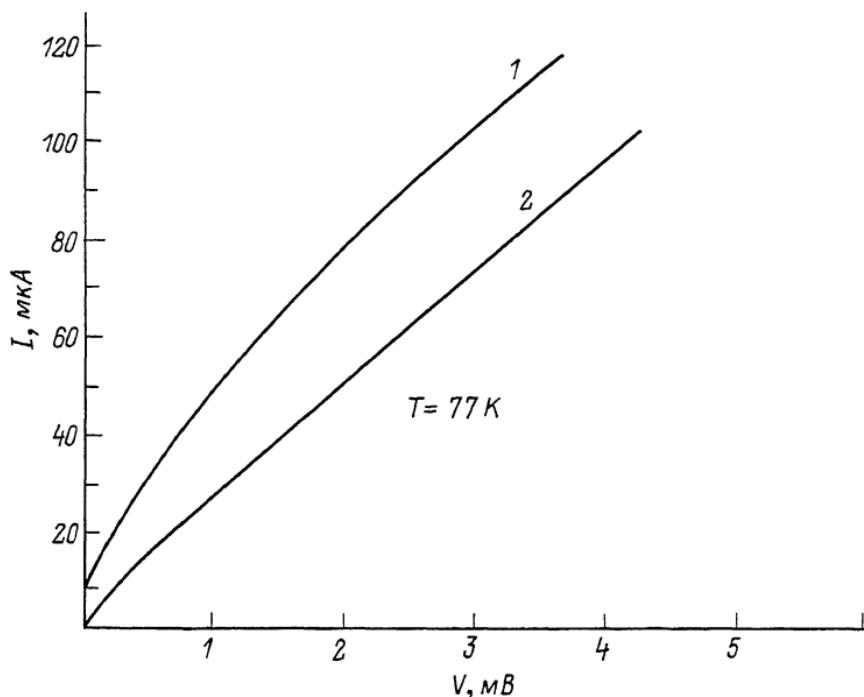


Рис. 1. ВАХ образца с $R_N = 40 \Omega$ при различных уровнях СВЧ-мощности: 1 – $P = 0$, 2 – $P = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Вт}$.

регулируемым короткозамыкающим поршнем на конце. Детектируемый сигнал усиливался малошумящим предварительным усилителем с охлаждаемым трансформатором. Запись отклика в зависимости от напряжения на переходе производилась на двухкоординатном самописце. Величина подаваемого СВЧ-излучения измерялась на входе приемника.

Пленки $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ изготавливались методом лазерного распыления керамической мишени. Использовался $Nd:YAG$ лазер со следующими параметрами: длина волны излучения $\lambda = 1.06 \text{ мкм}$, частота следования импульсов $f_0 = 20-30 \text{ Гц}$, протяженность импульса 100 нс, плотность мощности излучения $\sim 10^9 \text{ Вт/см}^2$. Пленки напылялись на подогретые ($\sim 750 \text{ }^\circ\text{C}$) полированные ориентированные подложки из ZrO_2 (100), стабилизированного Y , с подслоем серебра [5]. Напыление осуществлялось в атмосфере кислорода при давлении $10^{-2} \text{ мм рт. ст.}$ Время напыления – 10 мин, толщина пленки $\sim 1 \text{ мкм}$.

После напыления производился кратковременный отжиг в течение 15–20 мин в потоке O_2 при температуре $960 \text{ }^\circ\text{C}$, после чего образцы остывали в печи в течение 1 часа до $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Мостиковая структура формировалась резом пленки пучком лазера. Ширина реза составляла 15 мкм. Единственными проводящими участками в этой области оставались один или два мостика, ширина которых составляла 50 мкм, а длина определялась шириной реза. С учетом того, что зерна в пленке имели размер единицы мкм, мостики содержали несколько десятков зерен.

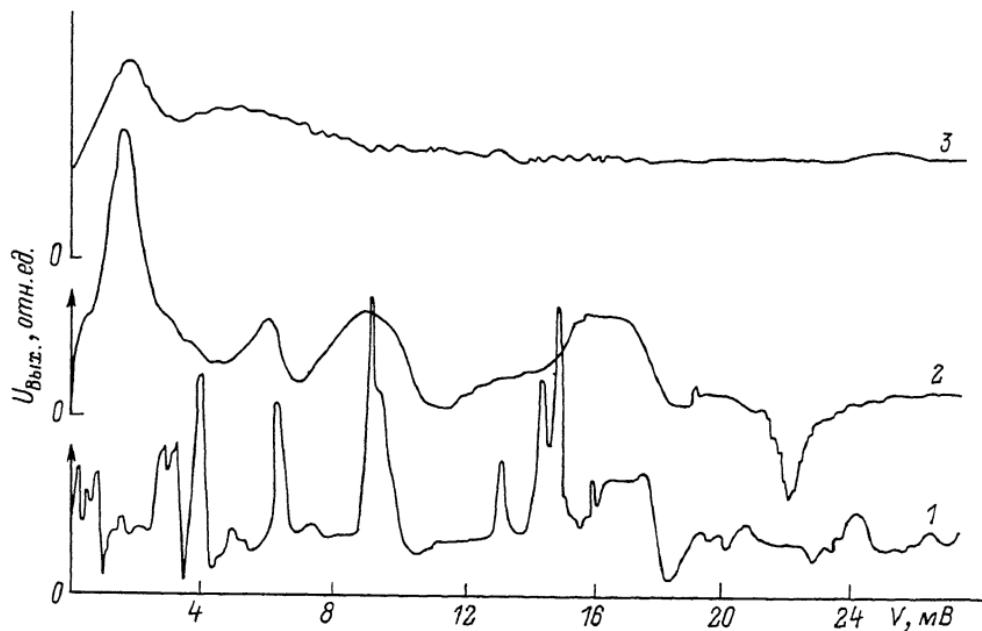


Рис. 2. Зависимости величины отклика $U_{\text{вых}}$ от напряжения смещения V на образце при различных температурах: 1 – 4.2 К, 2 – 38 К, 3 – 77 К.

Формирование контактных площадок к пленке осуществлялось напылением слоя Ag , остальная часть пленки с мостиками покрывалась напыленным слоем ZrO_2 для защиты от воздействия влаги.

Температура начала перехода в сверхпроводящее состояние составляла 92–93 К, окончания перехода – 86–88 К, значения сопротивления R_N таких структур находились в пределах единиц–десятков Ом при $T = 77$ К.

На рис. 2 приведены зависимости отклика от напряжения смещения для образца с $R_N = 40$ Ом. Отклик имел вид, характерный для множественных параллельно–последовательно соединенных переходов, что типично для гранулированных структур [4].

С повышением температуры максимумы на зависимостях величины отклика от напряжения на образце смещаются в сторону меньших токов и уширяются. Поскольку максимальное значение отклика каждого перехода соответствует начальному участку ВАХ, подобное поведение вызывается уменьшением критических токов отдельных переходов.

Возрастание тепловых шумов приводит к уширению пиков за счет размытия и перекрывания критических токов этих переходов.

Увеличение рабочей температуры приводит также к уменьшению числа межгранулированных границ, имеющих критический ток при данной температуре. Этим можно объяснить уменьшение числа отдельных пиков на представленных зависимостях.

Поэтому при $T = 77$ К зависимость величины отклика от напряжения имеет лишь один ярко выраженный пик, соответствующий начальному участку ВАХ.

Измерения вольт-ваттной чувствительности S и мощности, эквивалентной шуму (NEP) детектора проводились при напряжении смещения, соответствующих максимальному отклику. Вольт-ваттная чувствительность для контакта с $R_N = 40$ Ом составляла при 4.2 К $\sim 10^3$ В/Вт, соответствующее значение $NEP = 2 \cdot 10^{-12}$ Вт/Гц $^{1/2}$. При увеличении температуры до 77 К величина S уменьшается почти на два порядка.

Таким образом, исследование свойств широких мостиков в пленках высокотемпературных сверхпроводников показало: 1) ВАХ имеет вид, характерный для керамических образцов, межгранулярные связи в которых определяются эффектом близости; 2) детектирующие свойства определяются системой гранул и их границ, выделенных в объеме мостиков; 3) зависимость отклика от напряжения имеет вид множественных пиков, количество и величина которых уменьшается с ростом температуры.

Список литературы

- [1] Веревкин А.А., Грабой И.Э., Ильин В.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 22. С. 2075-2077.
- [2] Fan Changxin, Yu Liangkai // Mod. Phys. Lett. B. 1988. V. 1. N 11. & 12. P. 431-435.
- [3] Gerginis I.S., Titus J.A., Cobrin P.H., Harker A.B. // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 53. N 22. P. 2226-2228.
- [4] Куликов В.А., Матвеец Л.В. // ЖТФ. 1979. Т. XLIX. В. С. 664-667.
- [5] Ермолов С.Н., Кислов Н.А., Марченко В.А. и др. XXV Всесоюзное совещание по физике низких температур. Тезисы докладов, 26-27 октября 1988, Л. Ч. 1. С. 161-162.

Поступило в Редакцию
10 апреля 1989 г.